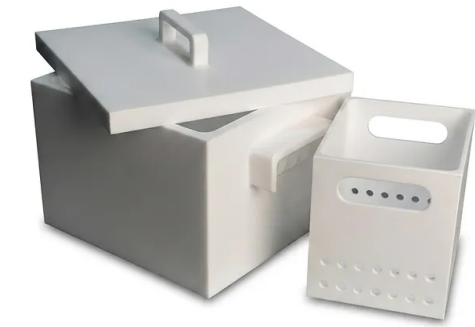


カスタムPtfе角型タンク 半導体浸漬洗浄 耐酸性フッ素樹脂濾過槽

商品番号: PL-CP53



前書き

当社のカスタムPTFE角型タンクは、優れた耐酸性と微量分析の純度を実現し、半導体製造の効率を最大化します。これらの高性能フッ素樹脂製容器は、今日の要求の厳しい実験室および産業プロセスにおいて、汚染のない浸漬と信頼性の高い化学薬品処理を保証します。

詳細を学ぶ

用途	説明	主な利点
半導体ウェハーエッチング	表面改質および汚染除去のために、濃酸浴にシリコンウェハーを浸漬する。	金属イオン汚染を防ぎ、攻撃性の高いHF/HNO3混合物に耐える。
太陽電池製造	大規模太陽光発電製造ラインでのシリコン基板のテクスチャリングおよび洗浄。	大量の耐久性とアルカリ性エッチング溶液への耐性。
微量分析サンプル準備	ゼロ汚染のベースラインを確保するための、実験室用ガラス器具の酸分解および浸漬。	PPTレベルの検出限界に不可欠な超低溶出プロファイル。
貴金属回収	王水またはシアン化物溶液中の金属溶解のための反応または浸漬容器としての使用。	酸化攻撃に対する完全な耐性と高温安定性。
航空宇宙部品の洗浄	腐食性化学薬品を使用した高精度エンジン部品の脱脂およびスケール除去。	ヘビーデューティーサイクルを備えた過酷な産業環境での長期的な信頼性。
製薬化学合成	高純度医薬品製造における腐食性試薬の取り扱いプライマリ容器としての役割。	FDA準拠と非粘性表面による滅菌の容易さ。
バッテリー研究およびテスト	加速老化および性能テストのための電解質溶液中での電極材料の浸漬。	さまざまなリチウム塩および有機炭酸塩との化学的適合性。

マイクロエレクトロニクスフォトリソストロッピング	高温での特殊溶剤ブレンドを使用した基板からの有機コーティングの除去。	熱応力および溶剤暴露下での構造的完全性を維持します。
--------------------------	------------------------------------	----------------------------

パラメータ	PL-CP53の仕様
ベース素材	100%パージン高密度PTFE（ポリテトラフルオロエチレン）
オプション素材	透明性または化学的純度の向上のためのPFA（パーフルオロアルコキシ）
寸法（長さ x 幅 x 高さ）	完全にカスタマイズ可能（クライアントの作業スペースとバッチサイズに合わせて調整）
壁厚範囲	カスタマイズ可能（標準5mm〜30mm以上、容量に基づく）
動作温度範囲	-200°C〜+260°C (-328°F〜+500°F)
化学的適合性	普遍的（溶融アルカリ金属および特定のフッ素化剤を除く）
製造方法	5軸CNC加工/高精度溶接（必要に応じて）
内部機能	カスタマイズ可能なバッフル、フィルター溝、および段付きサポート

パラメータ	PL-CP53の仕様
ドレンシステム	オプションの統合PTFEボールバルブまたはNPTねじ込みポート
蓋構成	ルーズフィット、ボルトオン、またはヒンジ付きPTFEカバーが利用可能
表面仕上げ	機械加工された滑らかさ（Ra < 0.8 μmは要求に応じて利用可能）
耐荷重	特定の材料密度と容量をサポートするように設計